

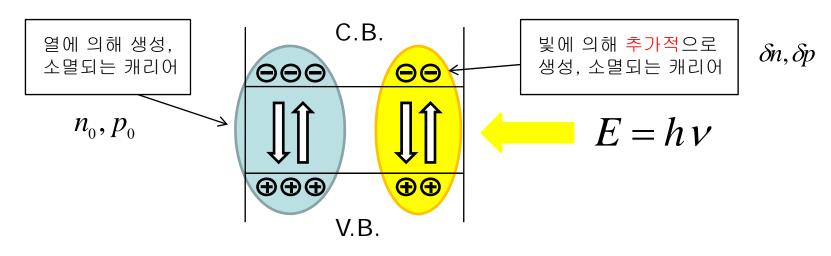
#### 6.1 캐리어 생성과 재결합

- ▶ 생성(generation) : 전자-정공 쌍을 형성하는 과정 또는 가전자대로부터 전도대로 전자가 勵起(excite)되는 과정
- ➤ 재결합(recombination) : 전자가 전도대로부터 가전자대로 이동함으로써 하나의 전자-정공 쌍(EHP)이 소멸되는 과정

#### 6.1.2 過剩(excess) 캐리어 생성과 재결합

(1) 빛에 의한 과잉 캐리어 생성

반도체 재료에 빛이 쪼여지면 빛으로부터 추가적인 energy를 받아 EHP가 증가



$$\therefore n = n_0 + \delta n, \quad p = p_0 + \delta p$$



- (2) 과잉 캐리어의 직접 재결합에 의한 감소
  - ▶ 비평형상태(non-equilibrium) : 과잉 캐리어가 존재할 때 반도체는 비평형상태가 됨
  - ▶ 빛이 차단되면 과잉 캐리어는 재결합에 의해 소멸되고 다시 평형상태로 돌아감
- (3) excess carrier의 시간에 따른 변화
  - (a) minority carrier의 경우
    - ① p-type 내에서 electron
      - ✓ 임의의 시각 t에서 excess carrier의 감소율은 그 시각에 존재하고 있는 electron과 hole의 양에 비례하므로

$$\frac{dn(t)}{dt} = -\alpha_r[n(t)p(t) - n_i^2]$$

여기서

$$n(t) = n_0 + \delta n(t)$$

$$p(t) = p_0 + \delta p(t)$$

따라서

$$\frac{d(\delta n(t))}{dt} = -\alpha_r \delta n(t) [(n_0 + p_0) + \delta n(t)]$$



✓ low level injection 조건과 p-type을 고려하면,

$$\frac{d(\delta n(t))}{dt} = -\alpha_r p_0 \delta n(t)$$

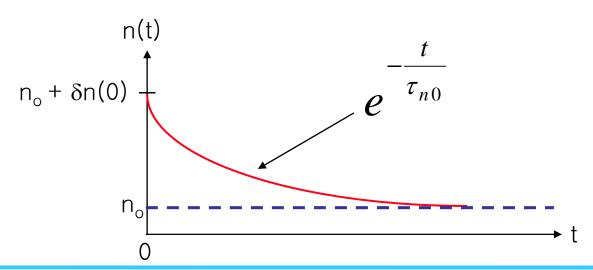
✔ 이 식의 해는,

$$\delta n(t) = \delta n(0)e^{-\frac{t}{\tau_{n0}}}$$

단,  $\tau_{n0}$ : excess minority carrier(electron) lifetime

✓ 이제 total electron의 시간에 따른 변화는,

$$n(t) = n_0 + \delta n(t) = n_0 + \delta n(0)e^{-\frac{t}{\tau_{n0}}}$$





② n-type 내에서 hole

✔ 비슷한 방법으로

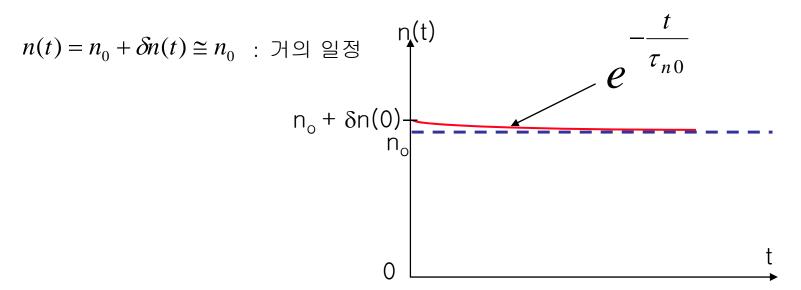
$$\delta p(t) = \delta p(0)e^{-\frac{t}{\tau_{p0}}}$$

단,  $\tau_{p0}$ : excess minority carrier(hole) lifetime

$$p(t) = p_0 + \delta p(t) = p_0 + \delta p(0)e^{-\frac{t}{\tau_{p0}}}$$



- (b) majority carrier의 경우
  - ① n-type에서, $n_0>>p_0$ ,  $n_0>>\delta n(t)$  이므로



② p-type에서,  $p_0>>n_0$  ,  $p_0>>\delta p(t)$  이므로

$$p(t) = p_0 + \delta p(t) \cong p_0$$
 : 거의 일정

즉, excess carrier가 지나치게 많이 주입되지 않는 한(⇒ 'low level injection') majority carrier의 양은 거의 변화가 없다고 볼 수 있다.



#### ❖ low-level injection (저준위 주입) condition

주입되는 과잉 캐리어의 농도가 열평형상태의 다수 캐리어 농도보다는 작고 소수 캐리어 농도보다는 큰 조건

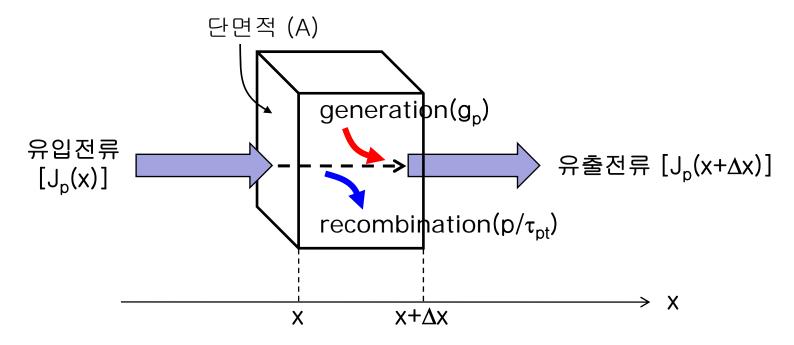
(예) n-type 반도체 시료의 경우

$$p_0 << \delta n(t) << n_0 \;, \quad p_0 << \delta p(t) << n_0$$



#### 6.2 과잉 캐리어의 특성

- 6.2.1 연속 방정식(連續 방정식, continuity equation)
  - ❖ hole에 대한 continuity equation 유도



-.  $\mathbf{x} = \mathbf{x}$ 에서 유입되는 hole density :  $\frac{J_p(x)}{e} \cdot A$ 

-.  $\mathbf{x} = \mathbf{x} + \Delta \mathbf{x}$  에서 유출되는 hole density :  $\frac{\boldsymbol{J}_p(\boldsymbol{x} + \Delta \boldsymbol{x})}{e} \cdot \boldsymbol{A}$ 



-. 단위 체적 당 유입, 유출되는 hole density의 차이:

$$\frac{A}{e}\{J_p(x) - J_p(x + \Delta x)\} \div (A \cdot \Delta x) = \frac{1}{e} \frac{J_p(x) - J_p(x + \Delta x)}{\Delta x}$$

- -. generation에 의해서 증가하는 hole density :  $g_p$
- -. recombination에 의해서 감소하는 hole density :  $-rac{p}{ au_{nt}}$
- -. 체적 **A**·**Δx**에서

$$\left. \frac{\partial p}{\partial t} \right|_{x \sim x + \Delta x} = \frac{1}{e} \frac{J_p(x) - J_p(x + \Delta x)}{\Delta x} + g_p - \frac{p}{\tau_{pt}}$$

-. ∆x → 0

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{e} \frac{\partial J_p(x)}{\partial x} + g_p - \frac{p}{\tau_{pt}}$$

- ❖ electron에 대한 continuity equation 유도
  - -. 같은 방법으로

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{e} \frac{\partial J_n(x)}{\partial x} + g_n - \frac{n}{\tau_{nt}}$$



#### 6.2.2 시간의존 확산 방정식(擴散 방정식, Diffusion Equation)

- (1) continuity equation의 재정리
  - -. hole 전류밀도 :  $J_p = J_{p|drt} + J_{p|drf} = e\mu_p pE eD_p \frac{dp}{dx}$

$$\therefore \frac{\partial p}{\partial t} = -\mu_p \left( \frac{\partial p}{\partial x} E + p \frac{\partial E}{\partial x} \right) + D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + g_p - \frac{p}{\tau_{pt}}$$

또한, 총 hole 농도는 평형상태의 hole 농도( $p_o$ )와 과잉 hole 농도( $\delta p$ )의 합이고  $p_o$ 는 시간, 공간의 함수가 아닌 일정한 값이므로

$$D_{p} \frac{\partial^{2} \delta p}{\partial x^{2}} - \mu_{p} \left( \frac{\partial \delta p}{\partial x} E + p \frac{\partial E}{\partial x} \right) + g_{p} - \frac{p}{\tau_{pt}} = \frac{\partial \delta p}{\partial t}$$

-. electron에 대해서도 같은 방법으로

$$D_n \frac{\partial^2 \delta n}{\partial x^2} + \mu_n \left( \frac{\partial \delta n}{\partial x} E + n \frac{\partial E}{\partial x} \right) + g_n - \frac{n}{\tau_{nt}} = \frac{\partial \delta n}{\partial t}$$



#### (2) diffusion equation

대부분의 경우, 반도체 소자를 흐르는 전류는 drift current 성분보다 주로 diffusion current 성분이 dominant 하므로

$$\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{p}} = \boldsymbol{J}_{\boldsymbol{p}|drt} + \boldsymbol{J}_{\boldsymbol{p}|dif} \cong \boldsymbol{J}_{\boldsymbol{p}|dif}$$

또한,

$$J_{p|dif} = -eD_p \frac{dp}{dx} = -eD_p \frac{d\delta p}{dx}$$

이므로 앞에서 구한 hole에 관한 continuity eq.은

$$D_p \frac{\partial^2 \delta p}{\partial x^2} + g_p - \frac{\delta p}{\tau_{pt}} = \frac{\partial \delta p}{\partial t}$$
: '(hole) diffusion eq.'

electron에 대해서도 같은 방법으로

$$D_n \frac{\partial^2 \delta n}{\partial x^2} + g_n - \frac{\delta n}{\tau_{nt}} = \frac{\partial \delta n}{\partial t}$$
: '(electron) diffusion eq.'



(3) diffusion length(확산거리)

정상상태(steady-state)의 경우,

$$g_p = 0, \quad \frac{\partial \delta p}{\partial t} = 0$$

이므로, hole에 관한 diffusion eq.은

$$D_p \frac{d^2 \delta p}{dx^2} = \frac{\delta p}{\tau_{nt}}$$

여기서

$$L_p \equiv \sqrt{D_p \tau_{pt}} \quad [cm]$$

 $L_p \equiv \sqrt{D_p \tau_{pt}}$  [cm] : '(hole) diffusion length'

로 놓으면

$$\frac{d^2 \delta p}{dx^2} = \frac{\delta p}{L_p^2}$$

electron에 대해서도 같은 방법으로

$$L_n \equiv \sqrt{D_n \tau_{nt}} \quad [cm]$$

 $L_n \equiv \sqrt{D_n \tau_{nt}}$  [cm] : '(electron) diffusion length'



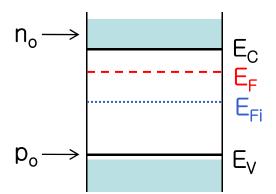
#### 6.4 유사-Fermi (Quasi-Fermi) 에너지 준위

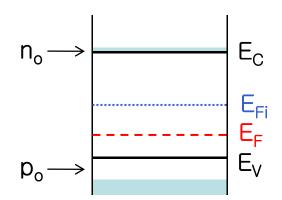
(1) 평형상태에서 불순물 농도, Fermi level, carrier 농도 간의 관계 ➡ Mass-Action Law

$$\begin{cases}
 n_o = N_D & \cdots \\
 p_o = \frac{n_i^2}{N_D} & \cdots \\
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
p_o = N_A & \dots \\
n_o = \frac{n_i^2}{N_A} & \dots \\
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
p_o = n_i \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_F}{kT}\right) & \dots \\
n_o = n_i \exp\left(-\frac{E_{Fi} - E_F}{kT}\right) & \dots \\
\end{cases}$$







- (2) Steady-state carrier generation의 경우: 비평형상태 📫 Mass-Action Law 불성립
  - $\checkmark$  steady-state하게 excess carrier가 주입되는 경우에는  $n \neq n_o, \quad p \neq p_o$  가 되어 비평형상태가 됨

$$\therefore np \neq n_o p_o = n_i^2$$

즉. Mass-Action Law가 성립되지 않음

✓ quasi-Fermi level (또는 imref)의 개념 평형상태의 식 ③, ⑦에 비추어 볼 때, 비평형상태에서는

$$\begin{cases}
 n = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fi}}{kT}\right) \\
 p = n_i \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_{Fp}}{kT}\right)
\end{cases}$$

로 놓을 수 있고,

이 때  $E_{Fn}$ ,  $E_{Fp}$ 를 각각 electron과 hole의 'quasi-Fermi level', 'imref'라고 함



\* (예)  $N_D=10^{15}\,\text{cm}^{-3}$  도핑된 반도체의 에너지 밴드 다이어그램

